

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 特 許 公 報 (B 2)

(11) 特許番号

第2525433号

(45) 発行日 平成 8 年 (1996) 8 月 21 日

(24) 登録日 平成 8 年 (1996) 5 月 31 日

| (51) Int.Cl. ⁶ | 識別記号 | 庁内整理番号 | F I | 技術表示箇所 |
|---------------------------|-------|--------|--------------|--------|
| G 0 1 L 9/04 | 1 0 1 | | G 0 1 L 9/04 | 1 0 1 |

発明の数 1 (全 4 頁)

| | | | |
|-----------|-----------------------|-----------|---|
| (21) 出願番号 | 特願昭62-298010 | (73) 特許権者 | 999999999 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台 4 丁目 6 番地 |
| (22) 出願日 | 昭和62年(1987)11月26日 | (73) 特許権者 | 999999999 株式会社日立カーエンジニアリング 茨城県ひたちなか市高場2477番地 |
| (65) 公開番号 | 特開平1-140037 | (72) 発明者 | 山口 真市 茨城県勝田市東石川西古内3085番地 5 日立オートモティブエンジニアリング株 式会社内 |
| (43) 公開日 | 平成 1 年 (1989) 6 月 1 日 | (72) 発明者 | 仲沢 照美 茨城県勝田市大字高場2520番地 株式会 社日立製作所佐和工場内 |
| | | (74) 代理人 | 弁理士 春日 譲 |
| | | 審査官 | 山川 雅也 |

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体歪ゲージ式圧力センサ

1

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 一面に歪ゲージを構成する拡散抵抗とこの抵抗に電気的に接続された電極とを有する半導体チップを備え、前記半導体チップの拡散抵抗及び電極が形成された面をゲル状の軟質レジンで被覆した半導体歪ゲージ式圧力センサにおいて、前記ゲル状の軟質レジンは、ジメチルシリコーンとフッ素シリコーンを変性させた耐寒性で耐溶材性のフロロシリコーン変性ジメチルシリコーンを主成分とし、フロロシリコーンレジンに架橋材として用いたフロロシリコーン

【発明の詳細な説明】

【産業上の利用分野】

本発明は半導体歪ゲージ式圧力センサに係わり、特に

2

ガソリン蒸気を含む気体の圧力測定に好適な半導体歪ゲージ式圧力センサに関する。

【従来の技術】

半導体歪ゲージ式圧力センサは、一面に歪ゲージを構成する拡散抵抗とこの抵抗に電気的に接続された電極とを有する半導体チップを使用するものであり、従来の半導体歪ゲージ式圧力センサは、特公昭58-7179号に記載のように、半導体チップの拡散抵抗及び電極が形成された面をゲル状の軟質レジンで被覆し、耐湿性の向上を図っていた。

【発明が解決しようとする問題点】

上記半導体歪圧力センサーにおいては、半導体チップを被覆する軟質レジンとして、主成分がジメチルシリコーン、架橋材がフェニールシリコーンを用いたシリコーンゲルを使用している。これは、電気絶縁性、耐湿性、

耐熱、耐寒性に優れているためである。しかしながらジメチル及びフェニールのシリコーンゲルは化学的に安定であるものの、耐溶材性、特に非極性溶材に対する耐溶材性が悪いという欠点を有している。ガソリンは非極性溶材の混合物（例えば、四塩化炭素、シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、ノルマルヘプタン）であるため、ジメチル、フェニールシリコーンをガソリン雰囲気中に置くと膨潤する。

従って、自動車のマニホールド圧力など、ガソリン蒸気やガソリンの液状粒子を含んだ流体の圧力を測定する場合には、ジメチル、フェニールシリコーンの軟質レジンがガソリン蒸気やその液状粒子に晒され、膨潤することにより、半導体チップに応力が発生し、圧力センサの出力がドリフトしたり、膨潤により信号取出用の金線を引張り、この金線の疲労破断を誘発し、また膨潤により圧力導入口を塞ぐという問題があった。

また上記問題を克服する方法として、半導体チップの位置する側の空間を圧力導入口に通じる側の空間から金属ダイアフラムで完全に遮断し、半導体チップの位置する側の空間に絶縁油を封入し、圧力導入口から半導体チップへの圧力の伝播はこの金属ダイアフラムと絶縁油を介して行う方法がある。しかしながらこの対策では、絶縁油の膨脹及び収縮による内圧の発生があり、ダイアフラムの応力軽減のためにダイアフラムは大型にならざるを得ない。また金属ダイアフラムを気密封止する必要があるので金属ダイアフラムをセンサハウジングに溶接しなければならず、このため金属ハウジングも金属となり、重量が重くなるという問題があった。

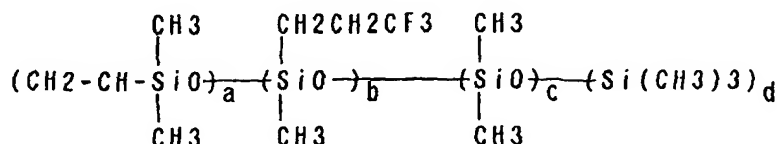
本発明の目的は、耐電気絶縁性、耐湿性、耐熱性及び耐寒性に加えて耐ガソリン性に優れ、かつ小形、軽量化の可能な半導体歪ゲージ圧力センサを提供することである。

【問題点を解決するための手段】

上記目的は、一面に歪ゲージを構成する拡散抵抗とこの抵抗に電氣的に接続された電極とを有する半導体チップを備え、前記半導体チップの拡散抵抗及び電極が形成された面をゲル状の軟質レジンで被覆した半導体歪ゲージ式圧力センサにおいて、前記ゲル状の軟質レジンが、ジメチルシリコーンとフッ素シリコーンを変性させた耐寒性で耐溶材性のフロロシリコーン変性ジメチルシリコーンを主成分とし、フロロシリコンレジンに架橋材として用いたフロロシリコーンゲルからなることにより達成される。

【作用】

*



* ガソリン蒸気やその液状粒子を含んだ流体の圧力測定時、上記フロロシリコーン変性ジメチルシリコーンを主成分とし、フロロシリコンレジンに架橋材として用いたフロロシリコーンゲルはガソリンに晒されてもほとんど膨潤せず、センサ出力の異常を来したり、金線を破断したり、圧力導入口を塞いだりすることはない。また、半導体チップをフロロシリコーンゲルで被覆するだけの簡単な構造であるので、圧力センサの小形、軽量化が可能である。

10 【実施例】

以下本発明の一実施例を第1図ないし第3図を参照して説明する。

第1図及び第2図において、符号1は本発明の半導体歪ゲージ式圧力センサであり、圧力センサ1はセンサハウジング2を有し、センサハウジング2には圧力導入口3が装着されている。センサハウジング2内にはチップハウジング4が装備され、このチップハウジング4には圧力導入口3に対向して圧力ポート5が形成されている。チップハウジング4内には、圧力ポート5に対向してガラス台6上に半導体チップ7が装着されている。

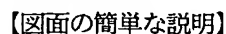
20 半導体チップ7は裏面に凹み8を有し、ガラス台6と気密に接着剤にて接合することによりこの凹み8に真空室を形成している。この真空室はチップハウジング4内に導入された気体の圧力を絶対圧力として測定するためのものである。ガラス台6はチップハウジング4に接着剤にて接合されている。

半導体チップ7の表面即ち圧力ポート5に対向した面には、拡散形成された抵抗と、この拡散抵抗相互の間及び拡散抵抗と外部との間の電氣的接続をとるため蒸着により形成されたアルミニウム電極とが備えられ、これら拡散抵抗及びアルミニウム電極により歪ゲージを構成している。アルミニウム電極はリード線9に金線10によりワイヤボンディングされている。

半導体チップ7の拡散抵抗及び電極が形成された上記面は、この面全体を包み込むように、耐溶材性の軟質フロロ系レジン11で被覆されている。この軟質フロロ系レジン11は、好ましくはフロロシリコーン変性ジメチルシリコーンを主成分として採用したフロロシリコーンゲルからなっている。

40 本実施例におけるこの軟質フロロ系レジン11を構成するフロロシリコーンゲルの構造式は以下の通りである。

(1) 主成分：フロロシリコーン変性ジメチルシリコーン



第1図は本発明の一実施例による半導体歪ゲージ式圧力センサの要部断面図であり、第2図はその半導体歪ゲージ式圧力センサの一部切除全体斜視図であり、第3図はその半導体歪ゲージ式圧力センサに使用されているフロロ系レジンのフッ素含有率とガラス転移点温度（耐寒温度）との関係を示す図である。

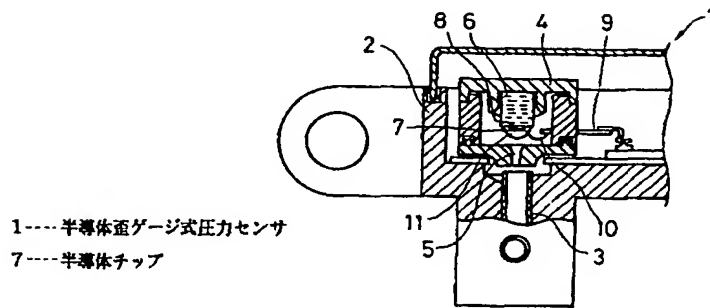
度）との関係を示す図である。

符号の説明

1……半導体歪ゲージ式圧力センサ

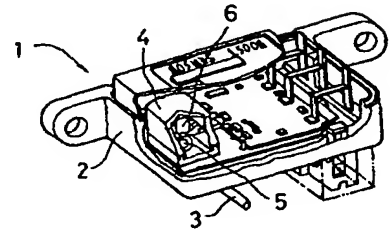
7……半導体チップ

【第1図】

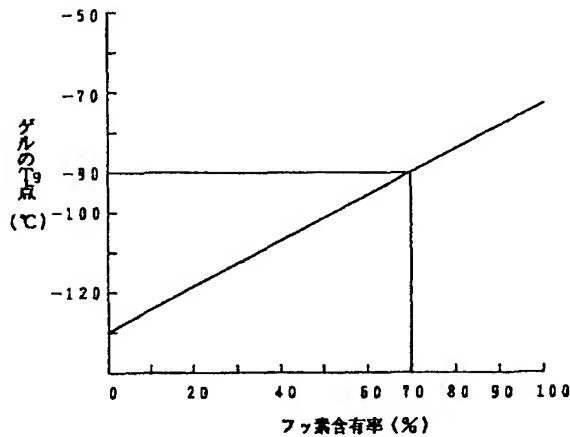


1……半導体歪ゲージ式圧力センサ
7……半導体チップ

【第2図】



【第3図】



フロントページの続き

- (56) 参考文献 特開 昭59-97029 (J P, A)
 特開 昭60-234812 (J P, A)
 特開 昭60-141738 (J P, A)
 特開 昭57-136132 (J P, A)